

A	MEMS/ナノ機能の複合技術	A	MEMS/半導体の一体形成技術	A	MEMS/MEMSの高集積結合技術	A	その他
1		2		3		4	

公開特許No.		図	
---------	--	---	--

D デバイス

DA	光制御デバイス	DB	電気制御デバイス	DC	流体制御デバイス	DD	認知(物理)デバイス	DE	認知(化学・バイオ)デバイス
DA01	光スイッチ	DB01	RFスイッチ	DC01	マイクロ流路	DD01	加速度センサ	DE01	DNAチップ
DA02	マイクロスキャナー	DB02	レゾネータ	DC02	マイクロバルブ	DD02	ジャイロ、レートジャイロ	DE02	蛋白質チップ
DA03	マイクロレンズアレイ	DB03	発振器	DC03	マイクロポンプ	DD03	圧力センサ	DEX	その他
DA04	マイクロミラー	DB04	フィルタ	DC04	流速計	DD04	赤外線センサ	DF	その他
DA05	減衰器	DB05	可変キャパシタ	DC05	圧力計	DD05	赤外線センサ	DF01	分子デバイス
DA06	回折格子	DB06	可変インダクタ			DD06	ポロメータ	DF02	ナノ構造体
DA07	スペクトロメータ					DD07	マイクロフォン(超音波含)	DF03	ナノ複合体
						DD09	ガス流量センサ	DDX	その他
DAX	その他	DBX	その他	DCX	その他	DDX	その他	DFX	その他

P プロセス

PA	成膜	PB	ドライエッチング	PD	洗浄	PG	接合	PI	マルチプロセス
PA01	常圧/減圧CVD	PB01	RIE	PD01	RCA、酸洗浄	PG01	陽極接合	PI01	MEMS・IC集積化
PA02	プラズマCVD	PB02	Deep-RIE	PD02	UV洗浄	PG02	Siフュージョンボンディング	PI02	表面マイクロマシーニング
PA03	スパッタ	PB03	プラズマエッチング	PD03	超音波洗浄	PG03	拡散接合	PI03	バルクマイクロマシーニング
PA04	EB蒸着	PB04	XeF2エッチング	PD04	機能水洗浄	PG04	ハンダ接合	PI04	リフトオフ
PA05	真空蒸着	PB05	O2アッシング	PD05	超臨界CO2	PG05	フリットガラス	PI05	LIGA
PA06	熱酸化	PB06	イオンミリング	PDX	その他	PGX	その他	PI06	型取り工程
PA07	スピニングコート	PBX	その他	PE	リソグラフィ	PH	パッケージ	PIX	その他
PA08	めっき	PC	ウェットエッチング	PE01	光	PH01	ワイヤボンディング	PJ	その他
PA09	SOG	PC01	Si異方性エッチング	PE02	EB	PH02	ダイボンディング	PJ01	ナノインプリント
PA10	ゾルゲル	PC02	Si等方性エッチング	PE03	XeF2エッチング	PH03	ハーメチックシール	PJ02	ホットエンボス
PA11	スプレコート	PC03	SiO2エッチング	PE04	X線	PH04	フリップチップボンディング	PJ03	ダイシング・切断
		PC04	SiNエッチング	PEX	その他	PH05	モールディング	PJ04	レーザーアブレーション
		PC05	金属材料エッチング	PF	不純物拡散・熱処理			PJ05	ドリリング・掘削
		PC06	樹脂材料エッチング	PF01	イオン注入			PJ06	研摩
				PF02	熱拡散			PJ07	ナノ選択成長
PAX	その他	PCX	その他	PF03	アニール	PHX	その他	PJ08	自己組織化
				PFX	その他			PJX	その他

M 材料

MA	半導体材料	MD	金属	ME	ポリマー	MF	ガラス/セラミクス	MH	形状記憶合金
MA01	単結晶シリコン	MD01	アルミニウム(Aluminum)	ME01	ポリイミド(polyimide)	MF01	石英	MH01	TiNi
MA02	ポリシリコン	MD02	クロム(Chromium)	ME02	PMMA(ポリメタクリル酸メチ)	MF02	ガラス	MHX	その他
MA03	アモルファスシリコン	MD03	銅(Copper)	ME03	厚膜レジスト	MF03	サファイア	MI	その他
MAX	その他	MD04	金(Gold)	ME04	バリレン(parylene)	MF04	ガラスフリット	MI01	ダイヤモンド
MB	酸化膜/窒化膜	MD05	モリブデン(Molybdenum)	ME05	サイトップ(CYTOP)	MF05	セラミクスパッケージ	MI02	DLC
MB01	SiO2	MD06	ニッケル(Nickel)	ME06	PDMS(polydimethylsiloxane)	MFX	その他	MI03	ナノカーボン系
MB02	PSG/BPSG	MD07	プラチナ(Platinum)	ME07	PC(ポリカーボネート)	MG	圧電材料	MI04	カーボンナノチューブ(CNT)
MB03	SiN	MD08	ルテニウム(Ru)	ME08	PEEK(ポリエーテルケトン)	MG01	PZT	MI05	その他のナノチューブ
MBX	その他	MD09	チタン(Titanium)	ME09	シクロオレフィン	MG02	PLZT	MI06	ナノワイヤ
MC	磁性材料	MD10	タングステン(Tungsten)	ME10	PTFE(ポリ四氟化エチレン)	MG03	ZnO	MI07	ナノドット・ナノ粒子・ナノカプセル
MC01	パーマロイ	MD11	Kovar	ME11	POM(ポリアセタール)	MG04	AIN	MI08	ナノ複合体
MC02	フェライト	MD12	42alloy	ME12	エポキシ(Epoxy)	MG05	PVDF		
MC03	鉄	MD13	ハンダ			MG06	水晶		
MC04	ニッケル								
MCX	その他	MDX	その他	MEX	その他	MGX	その他	MIX	その他

A 解析

AA	応力・ひずみ解析	AC	流体解析	AE	電磁界解析	AG	接合解析	AK	プロセス解析
AA01	線形構造解析	AC01	定常流体解析	AE01	静電界解析	AG01	クリープ解析	AK01	結晶異方性エッチング解析
AA02	非線形構造解析	AC02	非定常流体解析	AE02	静磁界解析	AG02	力学信頼性解析	AK02	プラズマエッチング解析
AA03	接触解析	AC03	非圧縮流体解析	AE03	調和磁界解析	AGX	その他	AK03	CVD解析
AA04	粘弾性解析	AC04	圧縮流体解析	AE04	過渡磁界解析	AH	その他力学解析	AK04	成膜
AA05	時刻歴応答解析	AC05	層流/乱流解析	AE05	電流解析	AH01	圧電解析	AK05	プロ
AA06	振動モード解析	AC06	非ニュートン流体解析	AE06	線形交流定常電磁界解析	AH02	ピエゾ抵抗解析	AK06	セス
AA07	調和応答解析	AC07	混相流解析	AE07	非線形静磁界解析	AH03	形状記憶解析	AK07	解析
AA08	熱弾塑性解析	AC08	自由表面解析	AE08	非線形過渡磁界解析	AHX	その他	AK08	電鍍解析
AAIX	その他	AC09	電気泳動解析	AE09	非線形定常時間周期磁界解析	AI	光学解析	AK09	リソグラフィ
AB	伝熱解析	AC10	電気浸透解析	AE10	周波数応答電磁波解析	AI01	導波路解析	AK10	エブリソグラフィ
AB01	熱伝導解析	AC11	希薄流体解析	AEX	その他	AI02	光強度解析	AK11	X線リソグラフィ
AB02	熱伝達解析	AC12	雰囲気気流体影響解析	AF	連成解析	AI03	光線解析	AK12	拡散解析
AB03	熱輻射解析	ACX	その他	AF01	応力ひずみ解析/電磁界解析	AIX	その他	AK13	イオン注入解析
		AD	システム解析	AF02	連成解析	AJ	半導体解析	AK14	変形・温度履歴継承解析
		AD01	システム解析	AFX	その他	AJ01	電気特性解析	AKX	その他
ABX	その他	ADX	その他			AJ02	容量解析	AL	その他
						AJX	その他		

C 特性

CA	基本特性	CC	力学特性	CC	力学特性	CE	光学特性	CG	圧電特性
CA01	密度	CC01	ヤング率	CC14	材料減衰	CE01	反射率	CG01	圧電定数(テンソル)
CA02	残留応力(初期応力)	CC02	ポアソン比	CCX	その他	CE02	屈折率	CG02	一定ひずみの誘電率マトリクス
CAX	その他	CC03	横弾性係数	CD	熱特性	CE03	吸収係数	CG03	圧電抵抗マトリクス
CB	磁気特性	CC04	弾性テンソル	CD01	熱膨張係数	CE04	複素屈折率	CGX	その他
CB01	材料タイプ(磁気特性)	CC05	引張・曲げ強度	CD02	熱伝導率	CEX	その他	CH	形状記憶特性
CB02	透磁率	CC06	降伏応力	CD03	比熱	CF	電気特性	CH01	変態温度
CB03	B-H曲線	CC07	硬さ	CD04	ガラス転移点	CF01	材料タイプ	CHX	その他
CB04	残留磁束密度	CC08	破壊靱性値	CD05	融点	CF02	比誘電率		
CB05	残留磁化	CC09	歪み硬化率	CD06	状態図	CF03	導電率		
CB06	飽和磁化	CC10	疲労	CD07	電気抵抗の温度係数	CFX	絶縁破壊強度		
CB07	ホール効果	CC11	クリープ	CD08	ゼーベック効果		その他		
CB08	磁気抵抗効果	CC12	粘度	CD09	焦電特性				
CBX	その他	CC13	その他	CDX	その他			CI	その他